

PECVD 前段電漿化學氣相沉積系統能力考核表

※ 晶片放入及取出的步驟

Pumping 畫面的操作.....

※ 參數設定

參數如何設定.....★

參數如何更改.....★

參數如何儲存.....★

※ 8 吋晶片放置注意事項

8 吋晶片放置演練說明.....★

※ 8 吋轉 6 吋載片操作注意事項

8 吋轉 6 吋載片如何放置.....★

8 吋轉 6 吋載片知晶舟放置方式.....★

載片位置顯示方式.....★

※ 製程畫面解說

溫度顯示說明.....

RF Power 顯示說明.....

Pressure 顯示說明.....

氣體流量顯示說明.....

製程時間顯示說明.....

※ 軟體操作

是否熟練.....★

※ 公告注意事項

機台旁的公告注意事項確實遵守.....★